

GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN SISTEMA DI RIMOZIONE DI MATERIALI IN PLASMA DELLA TIPOLOGIA RIE REACTIVE ION ETCHING NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO NFFA-DI CUP B53C22004310006 CIG A01C1D6834 CUI F80054330586202300313

CHIARIMENTI

Domanda:

buongiorno,

Il Capitolato tecnico, paragrafo 2.C punto d) riporta: "deve avere un Substrate Bias RF Generator Power Brand con automatic matching e con potenza di almeno un 1KW".

Si richiede conferma o meno del valore di potenza di almeno 1KW.

Grazie e cordiali saluti.

Risposta:

Buongiorno,

in merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si precisa che nel caso di sistema ICP, deve avere un RF Generator Power Supply (ICP source) con automatic matching e con potenza di almeno un 1KW".

Il Rup

Dott.ssa Caterina Vozzi